様式第一

年　月　日

経済産業大臣　名　　殿

住　　所
名　　称
代表者の氏名

情報処理の促進に関する法律第64条第１項の規定に基づき、下記の実施計画を作成し、提出します。

実施計画

１．名称等

事業者の氏名又は名称 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者名（事業者が法人の場合） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
資本金の額又は出資の総額 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
常時使用する従業員の数 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法人番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日本標準産業分類における該当中分類名称及びその番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
担当者連絡先（所属、氏名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２．公募対象半導体の生産の目標及び実施体制

（１） 公募対象半導体の生産の目標

（イ）公募対象半導体に関する内容

公募対象半導体	確認（注１）
演算を行う半導体であって、面積が 0.0187 平方マイクロメートル以下の電子回路（6個のＧＡＡ構造のトランジスターで構成されるものに限る。）をその内部に含むもの	□

（注１）記載された性能を満たす製品を生産する予定である場合は、□にレ印を付けること。

（ロ）公募対象半導体の生産の開始の時期

（注２）単なる試作に留まらず、顧客との継続的な取引を念頭に置いた商業生産を開始する時期を記載すること。

（２）公募対象半導体の生産の実施体制

（イ）経営体制及び企業統治体制に関する事項

（注３）資本関係についても記載すること。
（注４）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ロ）モニタリングの仕組み等に関する事項

（注５）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ハ）技術管理体制に関する事項

（注６）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ニ）コア技術等に関する事項

（注７）公募対象半導体の生産に有用かつ中核的な技術（公然と知られていないものに限る。）を「コア技術」と定義し、コア技術及びコア技術の実現に直接寄与する公然と知られていない技術を「コア技術等」と定義する。
（注８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

３．公募対象半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎

（１）前工程について

項目	具体的な内容について
生産技術・生産工程の開発状況	
生産設備（搬送装置等）の開発状況	
ＥＵＶ露光技術の開発状況	
パイロットラインの構築状況	
テストチップの試作状況	
歩留まりに係る状況	
ＰＤＫ・ＩＰの開発状況	
その他	

（注９）必要に応じて各項目の記載内容を証明又は補足する書類を提出すること。

（２）後工程について

項目	具体的な内容について
パッケージ生産技術・生産工程の開発	
パッケージ設計技術の開発	